(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩公開特許公報(A)

①特許出願公開

50Int. Cl.3 H 01 L 31/04

庁内整理番号 6655-5F

砂公開 昭和55年(1980)4月8日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

9)光起電力素子

②特

昭53-121460

22出

昭53(1978)10月4日

⑫発 明者 高須賀馨

富士市鮫島2番地の1旭化成工

業株式会社内

明 荒川辰美 ⑫発 者

富士市鮫島 2 番地の 1 旭化成工

業株式会社内

仍発 明 松下文夫。

富士市鮫島2番地の1旭化成工

業株式会社内

の発 明 小林秀彦

富士市鮫島2番地の1旭化成工

業株式会社内

ŒШ 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6

1. 転明の名象

光起電力素子

さ10~1000~の歌化物半端休の層、及び 厚さ50~200~の金異鉄階を駅次形成して なる光起電力素子

酸化物半導体が、 BEO₂ 、 TiO₂ 、 BEO 、 BiQ IngO; , N10 , YeO , CugO , BaO からなる群か ら少なくとも一つ道はれるものである特許請求の 範囲第1項記載の光起電力素子

蒙化物半導体の層が 8 mO2 、 T1O2 、 2 mO 、 810、IngO, NiO、FeO; CugO、BaO から大 る群から二つ以上選ばれ、多層構造である特許費 求の森田弟1項又は第2項記載の光起電力素子 酸化物半導体の層が還元雰囲気内で設けられ たものである特許請求の範囲第1項乃至第5項何 れか配装の光磁電力業子

シラン中のグロー放電分解法で得ら れる非晶質シリコンを用いた新規な光起電力業子

太陽エネルゲーを直接電気エネルゲーに変換す ることができる光処電力素子、いわゆる太陽電池 をエネルヤー根として利用する考え方は古くから ある。しかし、このエネルヤー演としての太陽電 旅の現在に於ける最も大きな問題点は、従来の他 の手段による発電方式に比して、発電コストが比 教にならない程復めて高値であるという点である。 従つて、太陽エネルヤーを将来のエネルヤー隊と して利用し得るようにする為に、太陽電池の大巾 なコストダウンが譲まれている。

最近、光起電力素子の製造方法としてシラン中 のグロー放電分解法で得られる非晶質シリコンを 用いると、結晶のそれに比べて、非常に違くし得 る事が報告されている。従つて半導体材料のコス h. ダウンが計れ、又、上記非異質シリコン膜を作 皮する時に必要なエネルヤーを、結晶成長に必要

なエネルヤーに比して非常に少なくできる為、製作コストも大巾に低級させる事が可能である。

しかし、現在のところ、ション中のグロー放電 分解法で得られた非晶質シリコンを用いた太陽電 他は、来だ満足いく変換効率が得られていず、実 用段階に適するに到つてない。

従つて、本発明の目的はシラン中のグロー放電 分解族で得られる非晶質シリコンを用いた太陽電 他のエネルギー変換効率を向上させる事にある。

本発明者らは、シラン中のグロー放電分解法で得られる非晶質シリコンを用い、新たに酸化物半 導体層を追加し、非晶質シリコン一酸化物半導体 一金属の構造を採用する事により、エネルギー変 換効率を大巾に向上させりる事を見い出し、本発 明をなすに到つた。

本発明の光起電力素子は、第1回に示す如く、ステンレス板、アルミニウム板、アンチモン板あるいは高濃度にドープした『辺の単結晶もしくは 多結晶のシリコン板等からなる場電性当板11の 表面にシラン中のグロー放電分解法によって厚さ

- 3 -

下する場合が多かつた。

しかるに本発明者らは、シラン中のグロー放電 分解法で得られる非品質シリロンを用いた光起電 力素子に対し酸化物半導体の層を追加して、卵品 質シリコン一酸化物学等体ー金属の構造を適用す る事によって、短絡電流、曲線因子等の減少を含 たす事なく、いちじるしく開放電圧を上昇させ得 るという面捌的な残棄を見いだしだものである。 本発明の酸化物半導体層13としては、8a0g、 TiO2 , ZnO, SiO , In2O; , NiO , PeO , Cn2Q Ba0 が好意に用いる事ができ、 8102 、 7102 、 ZuO、 BiO、 IngO; 、 NiO 等が特に好選である事 がわかつた。膜原は、10~10002とすれ ば良い事が確かめられた。なお、上記物質は単数 でも用いられるが、二種以上復居する事によって、 も特性が向上する事が解つた。又、上記絶録層 1.8を形成する際、水素ポス、シランガス等の量。 元雰囲気中で被着させる事により、一層の特性向 上がみられた。これは、酸化物半導体がより半導。 体的に作用する為であろうと思われる。

一般に先駆電力素子を太陽電池として利用する場合、取り出し得る電力を大きくする為には光照射時に於ける短絡電流、開放電圧及び光電流一電圧の曲線因子(フィルファクター)のそれぞれが大きい事が必要である。

従来、半導体装置の分野に於いて、WIB構造を有する素子が便用されているが、これは半導体とある種の金属との中間に色級層を介した接合を言う。結晶半導体を用いた従来のWIB構造光超電力業子は、半導体と金属層との中間に色級層を有しない通常のショットキ酸整型光超電力素子と比較して光照射時での閉放電圧はがなり上昇するが、組絡電視の低下あるいは曲線因子の減少をきたす為、総合的なエネルギー変換効率はむしろ低

以下に本発明による具体的な実権例について説 明する。

第2図に於いて、導電性基製21はパフ仕上に よつて鏡面に篆飾されたステンレス板(808304) である。との導電性基板21はアルミニウム等の 仕事関数の低い他のものでも良い。まず、详覚性 基板 2 1 を真空中で約 5 5 0 でに加熱する。その 様シラン(BIB』) とドーピングガスとしてのホ スフイン(PE。)をホスフインのシランに対する 比を100分の1として真空中に供給する。との 時、真空電の圧力は 0.5 Torr 前後とした。 次に グロー放電を発生させると導電性毒板21に非晶 質シリコン22が被着を始める。第一層目のドー プされた非晶質シリコン22を200~程度被差 させた後、導電性茶板21の温度を300℃まで 下げ、シランのみを真空中に供給し、再びゲロー 放電を発生させ、第二層目の非晶質シリコン層。 2 3 を 2 月至 程度被着させる。以上で、導電性基 板とオーム性接触を成した非晶質シリコン基板。 20~が作成できる。次に非晶質シリコン基板

- 5 -

特朗 昭55-48978(3)

201を親知の蒸着装置又はスパッタリング装置 に入れ、まず、酸化物学導体2.4例とは2m0を 200 ² 程度非晶質シリコン層2.8の表面に被着 させる。この時、非晶質シリコン菌収2.0.1を連 当に加熱しても良いし、水素ガス・シランガス等 の差元雰囲気で行づても良い。次に金属膜層2.5 を上配絶銀層2.4の表面に5.0 ² 程度被着させる。 この金属膜層2.5 は、白金、金、パラジゥム等の 仕事関数の大きいものが望ましい。さらに必要に 応じて反射防止膜、集電框等を設け、本発明によ る先起電力索子が完成する。

次に酸化物半導体を多層に形成する場合の実施 例を示す。

第1の実施例と同様ドグロー放電分解法によって非晶質シリコン基板201を作成し、無熔接置に入れる。第5回に於いてまず、非晶質膜層の表面に2n0 8 1 を 1 0 0 2 程度 2n0 8 1 の表面に被着させ、絶無層を積層構造とする。次に全異層26を、上配絶鉄層32の表面に502 程度被着させ

-7-

第2回は実施例 - 1 の断面拡大器、第8回は実施 例 - 2 の断面拡大器、第4回は、本発明による先 起電力素子と、従来のショット中障整型先起電力 素子の電流一電圧停性を比較する図である。

世来のショットキ障整亜光起電力素子… 4 1

中許出職人 旭化成工業株式会社

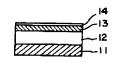
光起電力来子は、絶縁層24の無い、通常のショットや障整型光起電力来子と比べて、エネルヤー 変換効率の非常に良い太陽電池が得られる。

第1回は本発明による光起電力素子の構造を示す断面拡大区

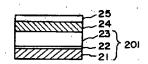
- 8 -

第 1 図

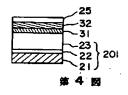
第 2 図

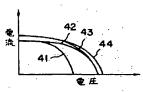


て完成する。



第3図





-9-